

# ナノ3D光干渉計測システム

VS1330

Nano 3D Optical Interferometer

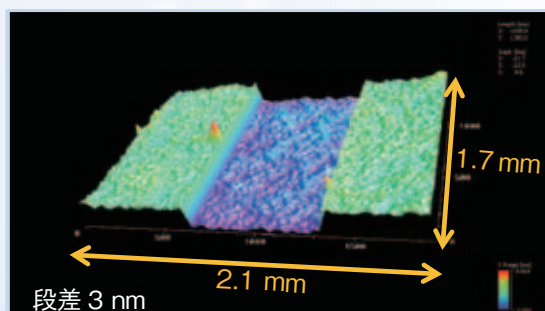
## ナノ3D光干渉計測システム (CSI) で解決しませんか？



VS1330

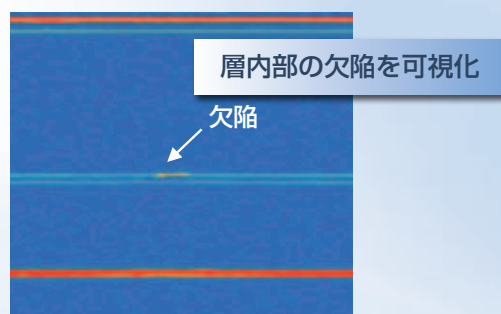
- 高さ分解能を落とさず、広範囲を測定したい
- 測定データの信憑性(再現性)を上げたい
- うねり・粗さの測定を実現したい
- 高アスペクト比の形状測定を行いたい
- 安定した透明体膜厚測定を実現したい
- フラットな表面から凹凸の大きい表面まで1台で計測したい

### 対物レンズ倍率に依存しない高さ分解能



薄膜段差 表面形状 ワンショット画像

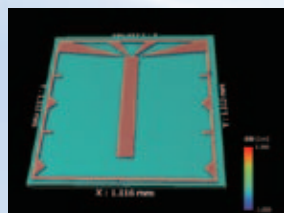
### 多層構造や層内部の欠陥評価が非破壊で可能



多層フィルム(偏光板)膜厚計測

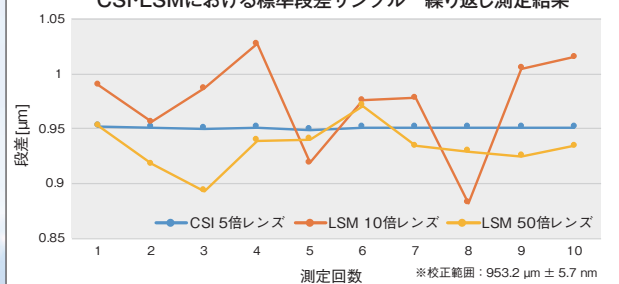
### 信頼性ある測定再現性

3 $\sigma$  : 1.8 nmで計測



950 nm標準段差サンプル

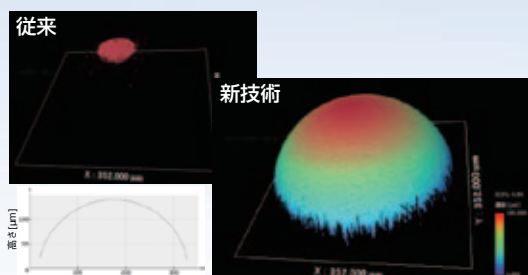
CSI・LSMにおける標準段差サンプル※ 繰り返し測定結果



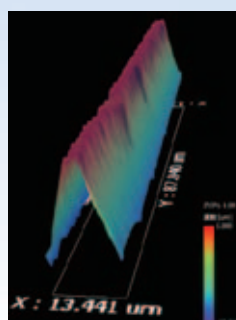
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CSI x5結果[ $\mu\text{m}$ ]	0.952	0.951	0.950	0.951	0.949	0.951	0.951	0.951	0.951	0.951
LSM x10結果[ $\mu\text{m}$ ]	0.990	0.956	0.987	1.027	0.919	0.976	0.978	0.882	1.005	1.015
LSM x50結果[ $\mu\text{m}$ ]	0.953	0.918	0.893	0.939	0.940	0.971	0.934	0.929	0.925	0.934

### 急峻な形状の測定を実現

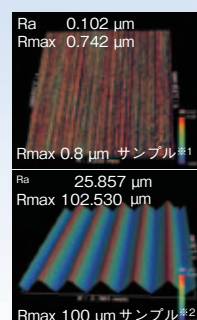
高傾斜測定 87°まで計測



φ400  $\mu\text{m}$  SUS球



デザインナイフ刃先



粗さ標準片

